スーパークリーンルーム産学官連携研究棟（SCR）装置一覧　　2025年4月1日現在

No.	装置番号	施設等名称	備考	
			メーカー名	型番
1	L01-104	ArF液浸レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK LITHIUS i+
	L01-103	ArF液浸露光装置	Nikon	NSR-S610C
2	M01-08	KrFレジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
	M01-10	KrF露光装置	Canon	FPA-5000ES3
3	U01-102	i線レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
	U01-101	IRアラインメント付i線露光装置	Canon	FPA-5510iZs
4	L01-104c	ArF液浸レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK LITHIUS i+
5	M01-08c	KrFレジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
6	U01-102c	i線レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
7	M01-04	レジスト塗布現像装置	東京エレクトロン	CLEAN TRACK ACT 12
8	B03-07	プラズマCVD装置	ASM	Eagle-12
9	M03-06	プラズマCVD装置	ASM	Eagle-12 Rapidfire
10	B03-06	プラズマCVD装置	Novellus systems	VECTOR
11	F03-103	プラズマCVD装置	Novellus systems	VECTOR
12	M03-01	高密度プラズマCVD装置	Novellus systems	Concept 3 Speed
13	P03-101	高密度プラズマCVD装置	三菱重工	MAPLE
14	M03-14	High-k ALD装置	東京エレクトロン	Trias
15	M06-04	メタルCVD装置	東京エレクトロン	Trias-W
16	F03-07	窒化膜LP-CVD装置	東京エレクトロン	TELFORMULA
17	M03-03	酸化膜LP-CVD(TEOS)装置	東京エレクトロン	TELFORMULA
18	P03-103	Doped-Si LP-CVD装置	日立国際電気	DJ-1226V-DF
19	U03-101B	プラズマCVD装置	Applied Materials	PRODUCER GT Staircase
20	B06-101	バリアシードスパッタ装置	Applied Materials	Endura2 EnCoReII Ta/Cu
21	M06-03	メタルスパッタ装置	キャノンアネルバ	COSMOS I-1201
22	M06-07	メタルスパッタ装置	ULVAC	ENTRON W-300
23	B06-102	Cuめっき装置	Novellus systems	SABRE NExT
24	M02-04	Poly-Siエッチング装置	Applied Materials	Centura DPSII/Axiom
25	M02-05	メタルエッチング装置	Applied Materials	Centura DPSII/ASPII
26	B02-101	Low-k/メタルエッチング装置	Applied Materials	Centura Enabler/DPS232
27	M02-01	酸化膜エッチング装置	東京エレクトロン	Telius SCCM-Ox/DRM-Ox
28	M02-10	酸化膜エッチング装置	東京エレクトロン	Telius DRM-Ox/SCCM-Poly
29	B02-01	Low-kエッチング装置	東京エレクトロン	Telius SCCM-Ox
30	F02-101	新材料エッチング装置	日立ハイテクノロジーズ	U-8150
31	B02-03	アッシング装置	芝浦メカトロニクス	ICE300/RPA300
32	M02-07	アッシング装置	芝浦メカトロニクス	μASH300
33	P02-105	アッシング装置	芝浦メカトロニクス	ICE300/μASH300
34	M05-03	高エネルギー中電流イオン注入装置	日新イオン機器	EXCEED2300V
35	F05-101	低エネルギー高電流イオン注入装置	住友重機械	SHX
36	M03-101	RTA/RTP装置	Applied Materials	Radiance
37	M04-02	ゲート酸窒化RTO/RTP装置	東京エレクトロン	Trias SPA300
38	B04-01	縦型アニール装置	光洋サーモシステム	VF-5700B
39	M04-101	縦型酸化炉	東京エレクトロン	ALPHA-303i-K

No.	装置番号	施設等名称	備考	
			メーカー名	型番
40	M07-15	バッチ式洗浄装置	東京エレクトロン	UW300Z
41	M07-07	酸化膜ウェットエッチング装置	SES	VENUS
42	P07-104	窒化膜ウェットエッチング装置	S-TEC	SFAW-1201-008
43	M07-05	バッチ式スプレー洗浄装置	東京エレクトロン	ZETA 300 BE
44	U07-103c	Si裏面研削研磨装置洗浄ユニット	ディスコ	DGP8761SC
45	M07-02	枚葉式洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN MP-3000
46	M07-101	枚葉式洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SU-3000
47	M07-102	枚葉式洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SU-3000
48	P07-105	枚葉式洗浄装置	カナメックス	KC-A300CBT
49	M07-13	枚葉式新材料洗浄装置	SEZ	SEZ323
50	M07-09	スクラブ洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SS-3000
51	M07-12	スクラブ洗浄装置	SCREEN	AQUASPIN SS-3000
52	N07-101	STI、W CMP装置	東京精密	ChaMP-332M A-FP-3000M
53	P07-101	Cu CMP装置	荏原製作所	F-REX300E
54	U07-101	Oxide CMP装置	Applied Materials	Reflexion LK Oxide
55	B02-101D	Si深掘りエッチング装置	Applied Materials	Centura Silvia
56	U03-101A	プラズマCVD装置	Applied Materials	PRODUCER GT InViaII
57	U06-101	Cuめっき装置	東京エレクトロン	NEXX Cu ECD
58	U12-102	ウェハ接合装置	タツモ	WS3000
59	U07-102	ウェハエッジトリミング装置	ディスコ	DFD6860
60	U07-103	Si裏面研削研磨装置	ディスコ	DGP8761HC
61	M08-55	重ね合わせ精度測定装置	KLA-Tencor	Archer10-AIM
62	P08-116	重ね合わせ精度測定装置	KLA-Tencor	Archer10-AIM
63	M08-07	分光エリプソ膜厚測定装置	KLA-Tencor	ASET-F5
64	M08-101	分光エリプソ膜厚測定装置	KLA-Tencor	ASET-F5X
65	P08-108	分光エリプソ膜厚測定装置	日本セミラボ	μSE-2500-A
66	I08-101	分光エリプソ膜厚測定装置	J. A. Woollam	M-2000X
67	P08-104	反射分光膜厚測定装置	Filmetrics	F50-EXR
68	M12-08	蛍光X線膜厚測定装置	リガク	System 3272E
69	F08-04	X線回折装置	リガク	TTR In-plane XRD
70	B12-101	反り/膜応力自動測定装置	FSM	128LC2C
71	M08-12	反り/膜応力測定装置	FSM	128L
72	P08-105	パーティクル検査装置	TOPCON	WM-10
73	P08-106	パーティクル検査装置	TOPCON	WM-10
74	P08-107	全反射蛍光X線分析装置	リガク	TXRF 310Fab
75	P08-109	自動濃縮装置	イアス	Expert
	P08-113	ICP-MS質量分析装置	PerkinElmer	NexION 2000
76	M08-10	シート抵抗測定装置	KLA-Tencor	RS-100
77	P08-102	シート抵抗測定装置	日立国際電気	VR300DSE
78	I08-110	測長SEM装置	日立ハイテクノロジーズ	CG5000
79	L08-103	測長SEM装置	日立ハイテクノロジーズ	CG4000
80	P08-101	測長SEM装置	日立ハイテクノロジーズ	S-9380Ⅱ
81	P08-103	測長SEM装置	日立ハイテクノロジーズ	S-9380Ⅱ
82	P08-115	レビューSEM	Applied Materials	SEMVision G6
83	M08-40	光学顕微鏡	オリンパス	AL3110F

No.	装置番号	施設等名称	備考	
			メーカー名	型番
84	M08-50	光学顕微鏡	オリンパス	AL3110Ｆ
85	M12-101	光学顕微鏡	オリンパス	AL110
86	M12-102	光学顕微鏡	オリンパス	AL120
87	P08-110	超音波顕微鏡	Sonoscan	FastLine P300
88	P08-111	高精度微細形状測定機	小坂研究所	ET4000L
89	P08-112	赤外線顕微鏡システム	清和光学製作所	DSI-300SA-IR
90	P08-114	赤外線拡大鏡	タツモ	BL-3000A
91	J04-106	ヘリウムイオン顕微鏡	Carl Zeiss	ORION Plus
92	B08-02-01 AF08-402	FIB 装置 走査透過電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ 日立ハイテクノロジーズ	FB2100 HD-2700
93	J03-117	走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	S-4700
94	M08-04	走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	S-5000
95	B08-12	走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	S-5200
96	J03-118	フルオートプローバ テスター	東京エレクトロン Agilent	P-12XL 4073B/N9201A
97	M08-42 M10-01	フルオートプローバ テスター	東京エレクトロン Agilent	P-12XL 4073A
98	M10-05	フルオートプローバ テスター	東京エレクトロン Agilent	P-12XL 4076